

附錄五 申請操作單元（含設備元件）排放係數建置之規範

（一）規範內容：申請操作單元（含設備元件）排放係數建置之文件、方法、檢測組數及排放量計算公式規定。

（二）申請文件：

- 1、自廠係數建置方法申請作業：公私場所應填具「自廠係數建置方法申請書」，連同「固定污染源揮發性有機物自廠係數建置方法計畫書」或其他經主管機關指定文件，向主管機關提出自廠係數建置方法申請。

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建置方法計畫書」內容如下：

- （1）計畫目標。
 - （2）製程說明、廢氣流向圖與全廠揮發性有機物質質量流布說明（應包含固定污染源操作許可證影本（含內頁））。
 - （3）全製程原（物）料使用清單與污染源活動強度資訊（應包含近兩年污染源活動強度紀錄報表）。
 - （4）全製程設備元件清單，且應含近兩年例行性洩漏區間監測結果紀錄報表（申請設備元件係數者）。
 - （5）廢水處理設備設計圖說、原理及操作條件說明，且應含近兩年廢水處理量月報表（申請廢水逸散係數者）。
 - （6）儲槽設計圖說、原理及操作條件說明，且應含近兩年儲槽儲存物料進料量月報表（申請儲槽逸散係數者）。
 - （7）規劃採用之檢測原理及方法。
 - （8）規劃品保及品管作業方式（採用非屬中央主管機關公告標準檢測方法者需檢附）。
 - （9）規劃之儀器配置（採用非屬中央主管機關公告標準檢測方法者須檢附）。
 - （10）規劃之檢測採樣頻率、週期與組數。
 - （11）自廠係數計算原則說明。
 - （12）其他經主管機關指定事項。
- 2、自廠係數建置結果申請作業：公私場所應填具「自廠係數建置結果申請書」，連同「固定污染源揮發性有機物自廠係數建置結果報告書」或其他經主管機關指定文件，向主管機關提出自廠係數建置結果申請。

「固定污染源揮發性有機物自廠係數建置結果報告書」內容如下：

(1) 經主管機關審核「固定污染源揮發性有機物自廠係數建置方法計畫書」之審核結果。

(2) 採用之檢測原理、方法與檢測當時之產能條件狀況。

(3) 採樣當時儀器配置（採用非屬中央主管機關公告標準檢測方法者須檢附）。

(4) 檢測採樣頻率、週期與組數。

(5) 原始檢測報告（應包含品保及品管各項作業執行結果說明）。

(6) 自廠係數試算作業。

(7) 其他經主管機關指定事項。

(三) 建置方法：公私場所進行操作單元（含設備元件）自廠係數建置申請作業，其採用之檢測方法應符合第六點(三)規定。

(四) 檢測組數及排放量計算方式（申請設備元件者）：應依最近一季之元件洩漏檢測結果，決定欲建立排放係數之設備元件型式，並統計該型式設備元件分布在各洩漏濃度(C) ($100\text{ppm} < C \leq 1000\text{ppm}$ 、 $1000\text{ppm} < C < 10000\text{ppm}$ 、 $C \geq 10000\text{ppm}$) 之總個數。取該型式設備元件在各濃度區間總個數之百分之五（不得低於四點次），於不同時間點，進行五批次元件洩漏檢測調查工作，取其平均值，提出申請。